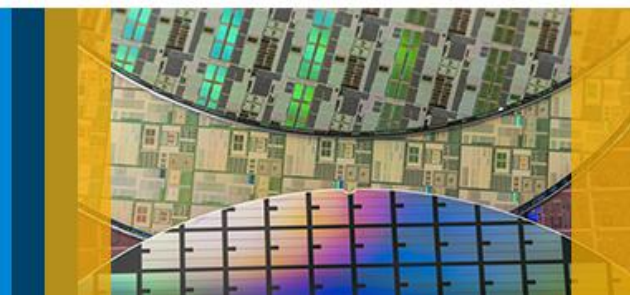


試薬・電子材料の ICP-MS 分析が ここまでスマートに！ 最新 ICP-MS MassHunter の全貌



開催概要

| 主 催 |
アジレント・テクノロジー（株）

| 日 程 |
2025 年 7 月 24 日（木）

| 時 間 | 15:00 – 16:00

| 参加費 | 無料

| 開催方法 | オンライン開催

| 定 員 | 200 名

| 申込方法 |
アジレントホームページへ
アクセスし、本セミナーページ
からお申込みください。



<https://aglt.co/UrUt>

▲ お申込みはこちら ▲

お問合せ先：
アジレント・テクノロジー(株)
セミナー事務局
0120-477-111
lscs_seminar@agilent.com

このたび、下記のとおり「試薬・電子材料の ICP-MS 分析がここまでスマートに！最新 ICP-MS MassHunter の全貌」と題したオンラインセミナーを開催いたします。

本セミナーでは、最新の ICP-MS MassHunter に搭載された半導体アプリケーション対応のプリセットメソッドなどの新機能をご紹介します。これにより、高純度試薬・電子材料の ICP-MS 分析がこれまで以上に効率的かつスマートに行えるようになります。皆様のワークフローがどのように改善されるか、具体的な活用例を交えてご紹介いたします。

また SEMI S2（半導体製造装置の環境、健康、安全に関するガイドライン）に対応した ICP-MS 用 キット もご紹介します。皆様のご参加をお待ちしております。

参加対象 | ICP-MS をお使いの半導体関連のお客様

時間	演題
15:00–15:05	開会の挨拶
15:05–15:25	ICP-MS MassHunter 5.4 の概要および SEMI S2 Kit のご紹介 半導体・電子材料向けの新機能を搭載した最新 ICP-MS MassHunter ソフトウェアの特長と、ご愛用中の Agilent 8900 ICP-QQQ を SEMI S2 対応にアップグレードするコンプライアンスキットの紹介をします。 *SEMI S2：国際的なエレクトロニクス製造工業会 SEMI が定める、半導体製造装置の作業環境や安全衛生に関するガイドライン アジレント・テクノロジー株式会社 宮下 和彦
15:25–15:45	ICP-MS MassHunter 5.4 のシンプルレシピの紹介 半導体製造プロセスで使用される様々な薬液中の金属不純物濃度管理に ICP-MS が利用されています。エンドユーザーとサプライヤー間の分析メソッドや結果の良好な相関を目指して搭載された、Agilent 8900 ICP-MS 用の新機能を解説します。 アジレント・テクノロジー株式会社 島村 佳典
15:50–16:00	質疑応答 (全体を通じて)